Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0214U008852

Державний реєстраційний номер: 0114U005243

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-11-2014

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вирощування нанодротин кремнію методом CVD та визначенння їх геометричних параметрів

Початок етапу: 06.2014

Закінчення етапу: 09.2014

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (032) 2375089

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 15

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Вирощування нанодротин кремнію методом CVD та визначенння їх геометричних параметрів

Назва роботи англійською:

Growing silicon nanowires by the CVD method and the determination of their geometrical parameters

Реферат українською:

Розглянуто та проаналізовано технологічні особливості методу хімічного нелектролітичного травлення, який придатний для створення впорядкованих масивів нанониток кремнію з потрібними розмірами та густиною Показано, що у цьому методі використовується шаблон з двовимірних частинок колоїдного кремнезему, на який наносять шар з благородного металу, що слугує каталізатором процесу травлення.

Реферат англійською:

Reviewed and analyzed the technological features of the method of chemical etching nonelectrolytic, which is suitable for the creation of ordered arrays of nanowires of silicon with the right size and density is shown that this method uses a two-dimensional pattern of the colloidal silica particles, onto which a layer of a noble metal that is a catalyst for the etching process.

Індекс УДК: 621.38.049.77.002; 621.375.82.002, 621.382.002;621.382.049.77.002

Коди тематичних рубрик: 47.13.11

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Дружинін Анатолій Олександрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Метод хімічного нелектролітичного травлення

Назва НТП англійською: The method of nonelectrolytic chemical etching

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: М.72.1. Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблено метод хімічного нелектролітичного травлення, який придатний для створення впорядкованих масивів нанониток кремнію з потрібними розмірами та густиною. Показано, що у цьому методі використовується шаблон з двовимірних частинок колоїдного кремнезему, на який наносять шар з благородного металу, що слугує каталізатором процесу травлення.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2015-2019

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Підприємства електронної техніки

Перспективні ринки: Україна, Польща, країни СНД

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 300

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 500

Очікуваний термін окупності (років): 4

Додаткова інформація: За договором

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Піх Зорян Григорович
д. х. н.

Перелік осіб-виконавців

Гарасим Ірина Данилівна

Дружинін Анатолій Олександрович

Корецький Роман Миколайович

Нічкало Степан Ігорович

Островський Ігор Петрович

Ховерко Юрій Миколайович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

